

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 5 月 21 日 (21.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/041477 A1

(51) 国際特許分類⁷: B24B 1/00, B23H 5/12, H05H 7/20

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014039

(22) 国際出願日: 2003 年 10 月 31 日 (31.10.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-323209 2002 年 11 月 6 日 (06.11.2002) JP
特願2002-323210 2002 年 11 月 6 日 (06.11.2002) JP
特願2002-323212 2002 年 11 月 6 日 (06.11.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社野村鍍金 (NOMURA PLATING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島 5 丁目 1 2 番 2 0 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 斎藤 健治

(SAITO, Kenji) [JP/JP]; 〒305-0045 茨城県つくば市梅園 2 丁目 2 7-1 4 Ibaraki (JP). 樋口 玉緒 (HIGUCHI, Tamao) [JP/JP]; 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町 5 番地 株式会社野村鍍金 鹿沼工場内 Tochigi (JP).

(74) 代理人: 岩谷 龍 (IWATANI, Ryo); 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2 丁目 1 番 2 7 号 桜橋千代田ビル 5 階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BR, BW, BY, BZ, CA, CN, CO, CR, CU, DM, DZ, EC, EG, GE, HR, ID, IL, IN, IS, JP, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MX, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, RU, SC, SG, SY, TJ, TM, TN, TT, UA, US, UZ, VC, VN, YU, ZA.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SURFACE TREATMENT METHOD FOR VACUUM MEMBER

(54) 発明の名称: 真空用部材の表面処理方法

(57) Abstract: A surface treatment method for a vacuum member utilized in all fields such as a medical field, an engineering field, an agricultural field, and the like, characterized in that the inner surface of the vacuum member is mechanically polished under the presence of a liquid medium not containing hydrogen atoms and the inner surface of the vacuum member is mechanically polished under the presence of the liquid medium containing an oxidizer, whereby the occlusion and the solution treatment of hydrogen into the surface of the vacuum member can be suppressed to increase the performance of the vacuum member.

(57) 要約:

本発明は、医学、工学、農学等のあらゆる分野で利用される真空用部材の表面処理技術に関する。

本発明は、水素原子を含まない液体媒体の存在下において、真空用部材の内表面を機械研磨することを特徴とする。

本発明は、さらに酸化性物質を含有させた前記液体媒体の存在下において、真空用部材の内表面を機械研磨することを特徴とする。

本発明によれば、真空用部材内表面への水素の吸蔵・固溶化を抑制でき、真空用部材の性能を高めることができる。

ATTACHMENT E

WO 2004/041477 A1